



OptoTech

MSI 60

Multifunktionales Stitching-Interferometer für hochaperturige Sphären bis \varnothing 100mm und optionalen Messen von Planoptiken



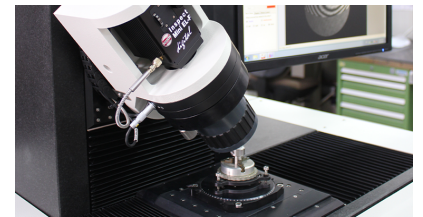
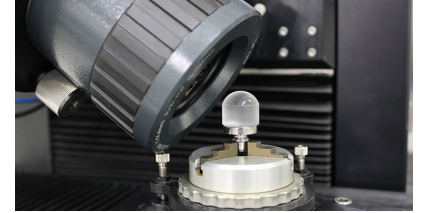
Multifunktionelles Stitching Interferometer zum Prüfen von hochaperturigen Sphären bis Durchmesser 100 mm und Planflächen bis Durchmesser 100 mm (optional).



OptoTech

Technische Daten

	MSI 60
Anwendung	Multifunktionelles Stitching Interferometer
Messbereich Durchmesser	0 mm - 100 mm
Verfahrweg B	0 ° - 90 °
Verfahrweg C	0 ° - 360 °
Verfahrweg X	0 mm - 350 mm
Verfahrweg Y	-15 mm - 15 mm
Verfahrweg Z	0 mm - 350 mm
Anzahl der Achsen	5 (X, Y, Z, B, C)
Strombedarf (andere auf Anfrage)	1 KW
Abmessungen	Breite: 850 mm, Höhe: 1950 mm, Tiefe: 900 mm
Gewicht (ca.)	800 kg
Disclaimer	Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech.





Highlights

- Multifunktionelles Stitching Interferometer MSI 60 zur Prüfung von hochaperturigen Sphären bis 100mm Durchmesser sowie Planflächen bis 100mm Durchmesser (optional)
- Messaufbau aus Granitstein, passiv luftgelagert
- Hochpräziser Radienschlitten in Z-Achs-Anordnung
- Invers-Anbau des Interferometer-Modul auf B-Achse
- Hochauflösende Schwenkachse (B-Achse) zur Positionierung des Strahlengangs über hochaperturigen Sphären
- Direkt-angetriebene Drehachse (C-Achse) zur Drehung von hochaperturigen Sphären und Planflächen im Strahlengang
- Bedienung wahlweise konventionell manuell oder mit automatischer Achssteuerung über OptoTech Stitching Software μ Stitch OWI
- Auswertung automatisch über OptoTech Interferometer Software μ Shape OWI
- Anbau von OptoTech Inspect Mini EL-F Digital 2" Fizeau-Interferometermodul
- Kompaktes Maschinengestell im OptoTech-Design mit integriertem PC-Arbeitsplatz

Optionen

- Passende Fizeau-Messobjektive
- Kipptisch zur Planflächen-Justierung
- Verschiedene Werkstück-Aufnahmen: Spannzange, Drei-Backen-Futter, HD12-, HD25-Futter